



用途

- オゾンガス・水装置のオゾン排ガス処理
- 半導体用洗浄装置 (O₃水洗浄、VUV洗浄※₁、O₃成膜など) のオゾン排ガス処理
- 水処理設備の余剰オゾン排ガス処理

※1: 大気中化で、UV照射を行い紫外線による洗浄・改質を行う表面改質方法

特長

- OZKオゾン分解器はハニカム形状の触媒を使用しており、低圧損・ロングライフ、なおかつ高濃度のオゾンガスを0.1ppm以下の濃度まで分解することが出来ます。
※2: 活性炭タイプ、粒状触媒方式のオゾン分解器のご対応も可能です
- 処理するオゾンガスの濃度、流量、湿度の条件をご提示いただけましたら、最適なオゾン分解器を起案設計し、御見積提案させていただきます。
- 本体形状および配管接続の取合い形状はご要望頂き、カスタマイズ可能です。

ラインナップ

オゾンガス分解器 (オゾンキラー) 低濃度用

型式	OZK-16K-2005	OZK-36K-2015	OZK-72K-2025
処理オゾンガス濃度 [ppm]最大	200	200	200
処理オゾンガス流量 [m ³ /min]最大	500	1500	2500
出口濃度 [ppm]以下	0.1	0.1	0.1
最大圧力損失 [kPa]以下	0.1	0.1	0.1
期待寿命 [約年]	1	1	1
寸法 [W×H×D] mm ※取合い部除く	364×407×330	514×557×330	514×557×560
質量 [約kg]	21.5	39.5	67

オゾンガス分解器 (オゾンキラー) 高濃度用

型式	OZK- I	OZK- II	OZK- III
処理オゾンガス濃度 [g/m ³ (N)] 最大	100	100	100
処理オゾンガス流量 [L /min] 最大	3	6	9
出口濃度 [ppm] 以下	0.1	0.1	0.1
期待寿命 [約年]	1	1	1
寸法 [W×H×D] mm	131×207×105	171×317×105	175×420×105
質量 [約kg]	1.6	2.5	3.6

※上記の機種以外にも、各種用途や要求に応じた装置のご紹介が可能です。

※カタログの内容は予告なしに改訂される場合があります。
※カタログに掲載している性能データは、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。

株式会社 ロキテクノマーケティング

本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-20-12
TEL.03-5764-1180 / FAX.03-5764-0681

www.rokitechno.com

当社、技術情報は
こちらから▼



ISO9001規格に適合した当社品質
マネジメントシステムに基づいて製造されています。

登録範囲

フィルターカートリッジ、ハウジング及びろ過装置の
設計・開発、製造及び販売



第4版

OZK2502001J